■第27回日本放射光学会奨励賞受賞研究報告

軟 X 線 MOKE 法の開発と物性研究への応用

久保田雄也 (理化学研究所放射光科学研究センター)

1. はじめに

固体は物性物理学の主要な研究対象の一つであり、固体 中の格子、そしてその上に配置された電子の電荷・軌道・ スピンの自由度によって様々な興味深い性質や現象が発現 する。各自由度、そしてそれらの相互作用を明らかにする ために、光をプローブとした測定が長年広く用いられてき た。放射光の比較的短波長領域の高輝度な光も固体の物性 研究に大変有用であることから、国内外で半世紀以上の歴 史を有しており、現在では専ら確立された手法のルーチン 利用が中心となっている。一方で、近年、放射光源・X 線自由電子レーザー (X-ray free-electron laser, XFEL) 光源ともに大きな進化を遂げており、これらの優れた能力 を最大限物性研究に活かすため、新たな手法の開発が望ま れていた。このような背景の中,筆者は軟 X 線から硬 X 線の幅広い波長領域において、最先端の放射光及び XFEL を駆使した革新的な物性研究手法の開発を行って きた。具体的には、(1)東京大学在籍時にその専用ビームラ インであった SPring-8 BL07LSU にて実施した,連続型 偏光変調軟X線光源の開発及び磁気光学効果への応用,(2) 日本唯一の XFEL 施設 SACLA の BL1 にて実施した,軟 X線 FEL を用いた高空間分解磁性測定法の開発, さらに, (3)同じく SACLA の BL3 にて実施した, 硬 X 線 FEL を 用いた超高速格子ダイナミクスの研究である。本稿では誌 面の都合上,これら三つのうち,タイトルにもある軟X 線 MOKE 研究にフォーカスし, (1)と(2)の研究テーマにつ いて紹介する。

連続型偏光変調軟 X 線光源の開発及び磁 気光学効果への応用

まず,連続型偏光変調軟X線(以下,変調軟X線とする)光源の開発とそれを利用した共鳴磁気光学カー効果 (magneto-optical Kerr effect, MOKE)測定の結果¹⁾につ いて述べる。誌面の都合上ここでは概略を述べるに留める が,詳細は原著論文¹⁾や「放射光」への過去の投稿記事²⁾ を参照していただきたい。

2.1 磁気光学効果

本研究では、固体の物性の中でも磁性(電子のスピン・ 軌道の自由度)に注目する。磁性分野における実験研究で は、その測定手法として、光をプローブとした測定が19

世紀より広く用いられてきた。そこで利用されるのが、磁 性体の磁化が光の偏光状態を変化させる磁気光学効果と呼 ばれる現象である。磁気光学効果には, 偏光面が回転する 磁気旋光性と左右の円偏光の吸収の差に由来する磁気円二 色性 (magnetic circular dichroism, MCD) が含まれ, そ れら二つの物理量から対象の磁性情報を得る。一般的には 可視光領域の光を利用することが多いが、放射光を利用 し、入射光の波長を軟X線領域まで拡張することで、多 数の磁性元素の吸収端をカバーできるようになる。つま り、元素選択的な測定が可能であるとともに、共鳴効果に より大きな信号が得られる。X線MCD (XMCD)³⁾は放 射光を使った最も有名な磁性測定手法である。さらに近年 では、MOKE にも軟 X 線を利用することで、元素選択的 かつ大きな磁気旋光性(カー回転角, *θ*_K)が得られるこ とがわかり、共鳴 MOKE として注目されている^{4,5)}。しか し, XMCD では MCD の情報, 共鳴 MOKE では磁気旋 光性の情報のみというように、二つの磁気光学量のうち、 一方の物理量しか取得が難しかった。この困難を克服し て、軟X線領域にて二つの磁気光学量の同時測定を可能 にし、その結果、物質の基本パラメータである誘電率テン ソルを求めることが本研究の目的であった。

2.2 光学遅延変調法

可視光領域の MOKE 測定には磁気旋光性と MCD を同 時測定する方法として,可視光レーザーの偏光を圧電振動 子を使って連続的に変調させ、その変調光を入射光として 用いる光学遅延変調法がある⁶⁻⁸⁾。この方法を軟 X 線領域 で実現するために重要なのが、SPring-8 BL07LSU⁹⁾が有 する世界唯一の分割型クロスアンジュレータである。分割 型クロスアンジュレータは、水平方向の直線偏光を発生す る水平8の字アンジュレータと垂直方向の直線偏光を発 生する垂直8(∞)の字アンジュレータの2種類のアンジ ュレータから成る。各4台のアンジュレータが交互に並 び,その間に移相器が7台設置されている。移相器は永 久磁石と電磁石で構成されており10, 電子ビームの軌道 を変えることで、水平と垂直の直線偏光間の位相差を制御 し、様々な偏光状態の高輝度軟X線の発生が可能であ る。この分割型クロスアンジュレータの特性を活かして、 変調軟X線光源を実現するには、電磁石移相器に交流電 流を加える。Fig.1は変調軟X線のイメージを表してい る。電磁石移相器に周波数レの正弦波交流電流を流すこと で、Fig. 1(b) に示すような、斜め直線偏光 (skew linearly,

(C) 2023 The Japanese Society for Synchrotron Radiation Research

放射光 Mar. 2023 Vol.36 No.2 ● 105

SL)から左右の円偏光へ周波数 v で切り替わる変調光源 が実現できる。この時の光学遅延量 *δ*は

$$\delta = \delta_0 \sin 2\pi v t, \tag{1}$$

という式で与えられる。ここで、 δ_0 は遅延量の振幅を表 し、直線から右または左円偏光へ連続的に変化する際は $\delta_0 = \pi/2$ となる。この変調光源を MOKE 測定の入射光と して用いると(光学遅延変調法)、磁性体からの反射光強 度のうち、MCDに由来する楕円率(ϵ_K)の情報がv成分 として、磁気旋光性に由来する θ_K が 2v成分として得ら れる。Fig. 1(c, d)はそれらの様子を図示している。つま り、検出信号からv、2v成分を抽出することで、MCDと 磁気旋光性の二つの磁気光学パラメータを同時にかつ高感 度に測定することが可能である^{6,7)}。本研究では、式(1)に おける偏光変調を、交流電流25±0.588 A を周波数 v= 12.987 Hz で加えることで実現させた。交流電流の振幅 0.588 A が $\delta_0 = \pi/2$ に対応し、左右の円偏光へと変化する。



Fig. 1 (Color online) (a) Image of the polarization-modulated light for the L-MOKE setup. (b) Time dependence of the retardation $\delta = (\pi/2) \sin 2\pi \nu t$. The polarization of light with retardation δ varies skew linearly (SL) \rightarrow right-handed circular \rightarrow SL \rightarrow left-handed circular \rightarrow SL. (c) and (d) Schematics how the ν and 2ν components represent MCD and the Kerr rotation, respectively. Projections onto the *x* axis of the electric field reflected from samples (c) with MCD and (d) with the Kerr rotation. [Taken from Ref. 1]

2.3 変調軟 X 線を用いた共鳴 MOKE 測定

Fig. 2に変調軟 X 線を入射光として用いた共鳴 MOKE 測定結果を示す。試料は厚さ30 nm の Fe 薄膜で, Fe L 殻 吸収端近傍にて測定した。試料面内方向かつ入射面に平行 に,飽和磁場以上の $B = \pm 0.3$ T の外部磁場を加えた。こ の磁場方向の MOKE 配置を縦 MOKE (longitudinal MOKE, L-MOKE) 配置という^{6,11)}。入射角 ϕ_i は試料の面 直方向から約80°とし,試料温度は室温で実験を行った。*s* 偏光, p 偏光を入射したことに相当する θ_K と ϵ_K のスペク トルがそれぞれ得られた。絶対値は実際の光の偏光度を考 慮して較正している。 θ_K と ϵ_K はクラマース-クローニヒ の関係で結ばれており,それを反映した,お互いの微分形 のスペクトルを示している^{11,12)}。*s* 偏光, p 偏光を入射し た時の L-MOKE で得られる θ_K と ϵ_K は以下の式で表現さ れる (それぞれの偏光を上付き添え字で表す)¹¹⁾。

$$\theta_{\rm K}^{\rm s} + i\varepsilon_{\rm K}^{\rm s} = -\frac{r_{\rm ps}}{r_{\rm ss}} \approx \frac{-in_0 nQ}{(n^2 - n_0^2)} \frac{\cos\phi_i \tan\phi_t}{\cos(\phi_i - \phi_t)},\tag{2}$$

$$\theta_{\rm K}^{p} + i\varepsilon_{\rm K}^{p} = -\frac{r_{sp}}{r_{pp}} \approx \frac{-in_0 nQ}{(n^2 - n_0^2)} \frac{\cos \phi_i \tan \phi_t}{\cos (\phi_i + \phi_t)}.$$
(3)

式中の r_{ij} は複素フレネル係数と呼ばれ、入射光のj偏光 電場と反射光のi偏光電場の比率を表す。また、 $n \ge n_0$ はそれぞれ磁性を担う Fe 薄膜と非磁性のキャップ層(今 回用いた試料では Ta/Cu)の複素屈折率であり、 ϕ_t は屈 折角である。式(2) と(3) において、磁気光学効果の情報



Fig. 2 (Color online) Results of L-MOKE measurements for an Fe nanofilm at the *L* edge using the polarization-modulated light for (upper) the *s* wave and (lower) the *p* wave. The red solid and blue open circles represent the spectra of $\theta_{\rm K}$ (left axis) and $\varepsilon_{\rm K}$ (right axis), respectively. [Reproduced from Ref. 1]

はフォークトパラメータ Qに含まれている。この Q は物 質の基本的な固有パラメータである複素誘電率テンソルの 2 成分の比で表すことができる。

$$Q = i \frac{\epsilon_{xz}}{\epsilon_{xx}},\tag{4}$$

ここで、本実験配置での誘電率テンソルは

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\epsilon}_{xx} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\epsilon}_{xz} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\epsilon}_{yy} & \boldsymbol{0} \\ -\boldsymbol{\epsilon}_{xz} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\epsilon}_{zz} \end{pmatrix},$$
(5)

と表せられる。対角成分は磁性情報を持たず, $\epsilon_{xx} = n^2$ で 与えられる。それに対して,非対角成分 ϵ_{xz} が磁気光学特 性を表し,磁性を議論する上で重要な物理量となる。式 (2),(3),(4)から,測定条件 $\phi_i \ge \phi_l$,磁性に依存しない $n \ge n_0$ の値がわかれば, $\theta_K \ge \varepsilon_K$ から ϵ_{xz} を求めることが できる^{13,14)}。Fig. 3(a)に,実際に変調軟 X 線を使って得ら れた $\theta_K \ge \varepsilon_K$ の結果から求めた, ϵ_{xz} のスペクトルを実部 虚部ともに示す。 ϵ_{xz} の実部,虚部の間にもクラマース-ク ローニヒの関係が成り立つため,スペクトルがそれを反映 した微分の関係になっている。さらに,第一原理計算の手 法^{15,16)}でバルクの Fe(bcc)に対する ϵ_{xz} のスペクトルも求



Fig. 3 (Color online) (a) ϵ_{xz} spectra of the Fe nanofilm at the *L* edge obtained by L-MOKE measurements with polarization-modulated light. The red solid and blue open circles represent real and imaginary parts of ϵ_{xz} , respectively. (b) Theoretical ϵ_{xz} spectra of bulk Fe (bcc) at the *L* edge obtained using the first-principles calculation within the KKR formalism. The red solid and blue broken lines represent the real and imaginary parts, respectively. [Reproduced from Ref. 1]

め、実験結果と比較を行った。その結果を Fig. 3(b) に示 す。スペクトルの絶対値、形状ともに実験値と良い一致を 示しているのがわかる。つまり、本研究で新たに開発した 測定手法と、本計算手法が、物質の最も基本的なパラメー タである複素誘電率テンソルを軟 X 線領域で求めるのに 大変有用であると言える。実験値では706 eV 辺りで ϵ_{xz} の 実部のピークと、虚部のディップが確認できる。これは、 Fig. 2 で見られる、 $\theta_{\rm K}$ と $\epsilon_{\rm K}$ スペクトルのディップまたは ピークに由来し、先行研究より、薄膜における干渉効果に よるものと言われている^{17,18)}。バルクに対する計算スペク トルで見られないことからも、試料の形状に由来するスペ クトル構造であると考えられる。

3. 軟 X 線 FEL を用いた高空間分解磁性測定 法の開発

3.1 SACLA BL1 での磁性研究

次に, XFEL を用いた固体物性研究について述べる。 リング型の放射光と比較した際の XFEL の特長として, 高強度性、超短パルス性、高コヒーレンス性が挙げられ る。物性研究では特に超短パルス性を活かして、光励起後 の超高速現象の研究がポンプ・プローブ法を用いて盛んに 行われている。SACLA BL1 でも軟 X 線 FEL と上述の共 鳴 MOKE を組み合わせた、フェムト~ピコ秒スケールの 磁性ダイナミクスの研究成果が発表されている19-21)。軟 X線 FEL を用いるメリットとしては、波長可変性を活か した,元素選択的な測定が可能な点が挙げられる。一方, 例えばスピントロニクスに代表される磁気デバイス開発で はµm~nmの微細構造内でのスピンの振る舞いが盛んに 研究されている。デバイスの高度化には、構造中の各元素 スピンのダイナミクスを調べることが重要であり、空間分 解能の向上も XFEL を用いた磁性研究において課題であ った。そこで本研究では、SACLA BL1 にて高空間分解 磁性測定手法を開発・実証し²²⁾,フェムト秒かつ nm の高 時空間分解磁性測定への展開を目標とした。

3.2 回転楕円ミラーを用いた高空間分解 MOKE 測定

高い空間分解能を得るために最も重要となるのが、いか に XFEL を小さく絞れるかであり、集光光学素子の性能 に大きく左右される。本研究では、東京大学三村研究室が 開発した、高精度回転楕円ミラーに注目した^{23,24)}。他の軟 X線集光素子と比較した際の回転楕円ミラーの特長は、 数 µm 以下の微小集光の実現はもちろんのこと、高スルー プット、色収差がない、大きな焦点距離(~10 mm)が 挙げられる。特に、軟 X線で元素選択的に磁性測定をす る上では、色収差がないことでスペクトル測定が容易であ り、かつ焦点距離が大きいことで反射配置や外部磁場印加 などの試料の自由度が高くなる点から非常に相性が良い。 Fig. 4 に測定のセットアップを示す。ビームライン常設の Kirkpatrick-Baez (KB) ミラー²⁵⁾との二段階集光により、



Fig. 4 (Color online) Schematic of the scanning MOKE measurement. The XFEL beam focused with the KB mirror is introduced to the ellipsoidal mirror, which produces a small focus onto the sample. The intensity of reflected beam from the sample was detected with the MCP. (inset) An optical microscopic image of the 50-nm-thick Fe film on the MgO (001) substrate with dots and line patterns. The diameter of dots pattern was $\phi = 50 \ \mu m$ and the width of line pattern was about 200 μm . An arrow indicates the scanned direction. [Reproduced from Ref. 22]

Feの*M* 殻吸収端近傍にて,full width at half maximum (FWHM) で 0.4μ m (垂直方向)× 1.6μ m (水平方向)の 集光サイズを実現した。この集光ビームを用いて MOKE 測定を行ったが,今回はシンプルなセットアップのため に,上述のL-MOKE ではなく,磁場方向によって反射光 強度が変化する横 MOKE (transverse MOKE, T-MOKE) 配置^{6,11)}を採用し,強度変化をマイクロチャンネルプレー ト (MCP) で測定した。試料は Fig. 4 の挿入図に示した ような,厚さ50 nmの Fe 薄膜で,ドットとラインのパ ターン構造を持つものを用い,磁気非対称度

$$R = \frac{I^+ / I_0^+ - I^- / I_0^-}{I^+ / I_0^+ + I^- / I_0^-},$$
(6)

が最も大きい55 eV の光子エネルギーの XFEL を入射光 とした。ここで、 I^+ (I^-) は外部磁場+B (-B) 時の反 射光強度で、 I_0^+ (I_0^-) はその際の入射光強度である。入 射光に対して図中の矢印の方向に試料を移動させること で、磁性の空間スキャンを実施した。その結果を Fig. 5 に 示す。基板の MgO では磁場方向に関係なく反射光強度が 一定であるのに対し, Fe が蒸着されている部分でのみ磁 場依存性が確認された。さらにその磁気非対称度から、本 装置の空間分解能が 7 μm であると評価できた。実際の集 光サイズに比べて大きな値となっているのは, MOKE 測 定における斜入射配置の影響と考えられる。現在はミラー の高度化を進めるとともに、これまでの共鳴 MOKE 測定 技術を集約した新しいエンドステーションを SACLA BL1 にて立ち上げ,サブ µm 集光の XFEL を用いた高空 間分解磁性測定や非線形光学実験を実施している。さら に,同期レーザーと組み合わせた高時空間分解測定の実現 に向け、高度化を進めているところである。



Fig. 5 (Color online) (a) Reflection intensity of the patterned sample as a function of the irradiation position with a 1 μ m step. The red solid and blue open circles represent the reflection intensity under the external magnetic field of +B and -B, respectively. The photon energy of the incident XFEL beam was fixed at hv = 55 eV. (b) Irradiation position dependence on the magnetic asymmetry ratio, *R*, obtained from the reflection intensity in (a). [Taken from Ref. 22]

4. おわりに

本稿では, SPring-8 BL07LSUの変調軟X線とSAC-LAの XFEL の新規光源を用いた固体物性研究について紹 介した。誘電率テンソルは光学素子を設計する上でも重要 なパラメータであるため, 高次高調波レーザーや軟X線 放射光技術の発展に大いに貢献し得ると期待している。 SACLAでは今回紹介した BL1 での磁性研究に加え, BL3²⁶⁾の硬 X 線 FEL を用いた物性研究も推進している。 これまで困難であった極低温におけるポンプ・プローブ X線回折測定用の装置を新たに開発し、10K以下での格 子や電子秩序状態の超高速ダイナミクスを捉えることが可 能となった27)。今後もBL1の新エンドステーションを用 いた高時空間分解磁性研究や非線形光学,BL3の極限環 境下での非平衡量子物性の研究をさらに推進していきた い。さらに、各ビームライン単独で進めるのではなく、各 波長の長所を活かしながら相補的に研究を行うことで、よ り一層の物性研究の発展に貢献したいと考えている。ま た、本誌の JSR2023 企画講演報告にもあるように、SAC-LAの XFEL 光源のより一層の高強度化,短パルス化,高 繰り返し化も今後期待される。その新光源と組み合わせた 新しい物性研究基盤の開発も引き続き進めていきたい。

謝辞

本稿で紹介した研究結果は論文^{1,22,27)}の共著者をはじめ とする多くの研究者との共同研究や有益な議論に拠ってい

ます。この場をお借りして感謝申し上げます。特に、東京 大学物性研究所の松田巌教授には学生時代から現在に至る まで数多くのご指導をいただきました。理化学研究所放射 光科学研究センターの矢橋牧名グループディレクター,高 輝度光科学研究センターの登野健介室長にも研究の進め方 から,XFELを使いこなす技術など多くのご指導をいた だきました。他にも、ここでは書ききれないほどの大勢の SPring-8, SACLAの関係者の方々のご協力のおかげで成 果を得ることができました。この場をお借りして御礼申し 上げます。

参考文献

- 1) Y. Kubota et al.: Phys. Rev. B 96, 214417 (2017).
- 久保田雄也, 松田巌: 放射光 33, 206 (2020). 2)
- 3) C. T. Chen et al.: Phys. Rev. Lett. 75, 152 (1995).
- 4) Y. Kubota et al.: J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 220, 17 (2017).
- 5) Y. Kubota et al.: Phys. Rev. B 96, 134432 (2017).
- 6) 佐藤勝昭:『光と磁気 改訂版』(朝倉書店, 2001).
- 7) K. Sato: Jpn. J. Appl. Phys. 20, 2403 (1981).
- 8) K. Sato, H. Kida and T. Kamimura: J. Magn. Soc. Jpn. 11, 113 (1987).
- 9) S. Yamamoto *et al.*: J. Synchrotron Radiat. **21**, 352 (2014).
- 10) I. Matsuda et al.: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. 767, 296 (2014).
- P. M. Oppeneer: in Handbook of Magnetic Materials, ed. K. 11) H. J. Buschow Vol. 13 (Elsevier, Amsterdam, 2001).
- 12) J. Kunes et al.: Phys. Rev. B 64, 174417 (2001).
- 13) H.-C. Mertins et al.: J. Magn. Magn. Mater. 240, 451

(2002).

- 14) L. Henke, E. Gullikson and J. C. Davis: https:// henke.lbl.gov/optical constants/
- H. Akai: http://kkr.issp.u-tokyo.ac.jp 15)
- H. Akai: J. Phys: Condens. Matter 1, 8045 (1989). 16)
- 17) H.-C. Mertins et al.: Phys. Rev. B 69, 064407 (2004).
- 18) S. Valencia et al.: Phys. B 345, 189 (2004).
- 19) Sh. Yamamoto, Y. Kubota et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 57, 09TD02 (2018).
- 20) K. Yamamoto et al.: Appl. Phys. Lett. 116, 172406 (2020).
- 21)I. Matsuda and Y. Kubota: Chem. Lett. 50, 1336 (2021).
- 22)Y. Kubota et al.: Appl. Phys. Lett. 117, 042405 (2020).
- 23) H. Motoyama et al.: J. Synchrotron Radiat. 26, 1406 (2019).
- 24)G. Yamaguchi et al.: Rev. Sci. Instrum. 92, 123106 (2021).
- S. Owada et al.: J. Synchrotron Radiat. 25, 282 (2018). 25)
- 26)T. Ishikawa *et al.*: Nat. Photonics **6**, 540 (2012).
- Y. Kubota et al.: Appl. Phys. Lett. 122, 092201 (2023). 27)



久保田雄也

理化学研究所放射光科学研究センター 基礎科学特別研究員 E-mail: kubota@spring8.or.jp 専門:固体物理,放射光科学 [略歴]

2017年3月東京大学大学院理学系研究 科物理学専攻博士課程修了。博士(理学)。 2017年4月高輝度光科学研究センター 博士研究員。2020年4月より現職。